

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 1 区分

【発行日】平成 18 年 3 月 9 日 (2006.3.9)

【公開番号】特開 2005-259706 (P2005-259706A)

【公開日】平成 17 年 9 月 22 日 (2005.9.22)

【年通号数】公開・登録公報 2005-037

【出願番号】特願 2005-107006 (P2005-107006)

【国際特許分類】

H 0 1 J 37/28 (2006.01)

G 0 1 N 23/225 (2006.01)

H 0 1 J 37/20 (2006.01)

H 0 1 J 37/30 (2006.01)

H 0 1 J 37/317 (2006.01)

【F I】

H 0 1 J 37/28 B

G 0 1 N 23/225

H 0 1 J 37/20 A

H 0 1 J 37/30 Z

H 0 1 J 37/317 D

【手続補正書】

【提出日】平成 18 年 1 月 20 日 (2006.1.20)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

試料を載置する試料台と；

微小試料を支持できるマニピュレータと；

微小試料を固定できる第 2 試料台と；

試料台、及び第 2 試料台が配置された試料室と；

試料台に載置された試料、及び第 2 試料台に固定された微小試料にイオンビームを照射できる集束イオンビーム光学系と；

第 2 試料台に固定された微小試料に電子ビームを照射できる電子ビーム光学系と；
を備え、

第 2 試料台に固定された微小試料が、イオンビーム及び電子ビームに対して所定の角度となるよう、第 2 試料台の角度を制御できるように構成された微小試料加工観察装置。